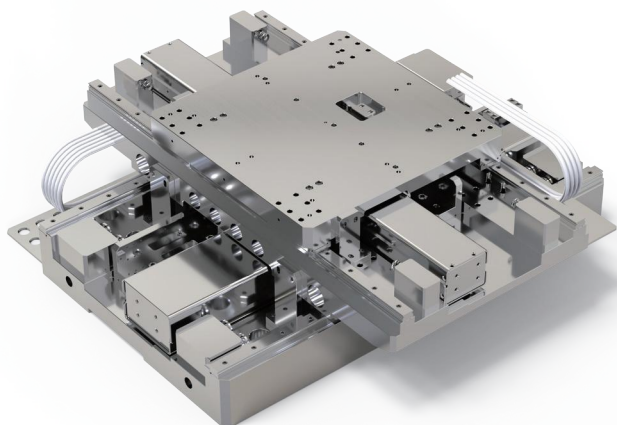


高真空精密二维位移台



主要特点

- 适用于 10^{-5} Pa及以下超高真空环境
- 低释气率、低发热真空直线电机驱动
- 独特的直线电机磁屏蔽设计
- 平台材料可选非磁性材料,整体漏磁可达nT级
- 优异的速度波动和位置稳定性

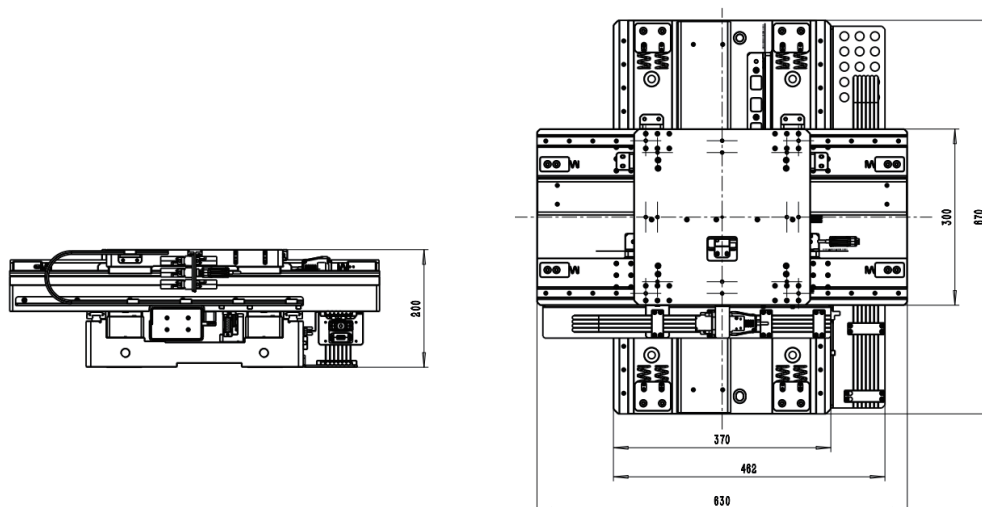
性能简介

高真空精密二维位移台采用了符合超高真空标准的材料和ISO6洁净室中的特殊工艺制造,确保可适用于 10^{-5} Pa及以下超高真空环境。在实现高精度、高刚度XY运动的同时,还保证了真空环境下的热管理与磁屏蔽需求。

主要应用

- 电子束检测
- 扫描电镜
- 电子束光刻

机械尺寸图



*接口尺寸数据来源于VLS200

技术参数

	VLS200-08		VLS200-12	
轴/Axes name	X	Y	X	Y
行程/Travel range	300 mm	220 mm	400 mm	320mm
最大速度/Max. velocity	0.35 m/s			
加速度/Max. acceleration	0.4 g			
精度/Accuracy	±1 μm	±1 μm	±1 μm	±1 μm
双向重复精度/Bidirectional repeatability	±0.5 μm	±0.5 μm	±0.5 μm	±0.5 μm
位置稳定性(3σ)*/Position stability(3σ)*	±5 nm	±5 nm	±5 nm	±5 nm
速度波动*/Velocity stability*	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%
直线度/Straightness	7.5 μm	7.5 μm	7.5 μm	7.5 μm
俯仰/Pitch	<20 arcsec	<20 arcsec	<20 arcsec	<20 arcsec
偏摆/Yaw	<20 arcsec	<20 arcsec	<10 arcsec	<10 arcsec
机械性能/Mechanical properties				
驱动负载(无负载)/Moving mass (without payload)	52 Kg	7 Kg	53.5 Kg	9 Kg
最大负载/Max. load	13.5 Kg		13.5 Kg	
平台质量/Stage mass	100 kg		145 kg	
外观尺寸/Dimensions	670 mm×630 mm×200 mm		810 mm×714 mm×200 mm	
平台材料/Material	铝合金			

*非主动减振环境下的测试数据。

定制信息

在真空产品序列里,配置了可根据用户实际应用选择的可选项。可选内容包括行程、编码器、控制系统等选项。

表 1 导轨选项

-G1	常规真空导轨
-G2	无磁真空导轨